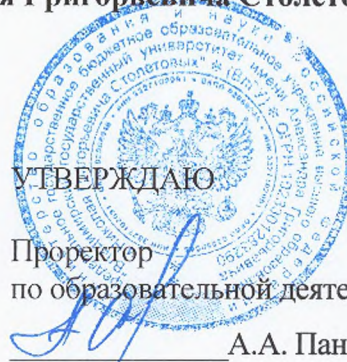


Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)



УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности

А.А. Панфилов

« 30 » 05 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы микро - и нанотехнологий»

Направление подготовки: 12.04.01 "Приборостроение"

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная

Семестр	Трудоёмкость зач. ед, (час)	Лек- ций, час.	Практ. занятий, час.	Лабор. работ, час.	СРС, час.	Форма проме- жуточного кон- троля (экз/зачёт)
2	3/108	-	36	-	72	Зачёт с оценкой
Итого:	3/108	-	36	-	72	Зачёт с оценкой

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Основы микро – и нанотехнологий» являются:

- формирование знаний о закономерностях физико-химических процессов микроэлектроники, базовых операциях и ограничениях полупроводниковой технологии;
- формирование знаний о возможности использования физических, химических, биологических явлений для создания наноматериалов и наноустройств, методах их синтеза, исследования и применения в приборостроении;
- формирование представлений об основных направлениях развития нанотехнологий в области приборостроения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы микро – и нанотехнологий» относится к вариативной части ОПОП ВО (код Б1.В.ДВ.1) Дисциплина изучается в 2 семестре. Необходимые для освоения дисциплины знания, умения и готовности обучающегося приобретаются в результате изучения физики, химии, математики, основ электротехники, электроники, материаловедения. Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения научно-исследовательской работы и выпускной квалификационной работы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Код компетенции по ФГОС	Компетенция	Планируемые результаты обучения
ОПК-2	Способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы.	Знать: основные процессы и направления развития микро - и нанотехнологий, методы синтеза, исследования и применения наноустройств в приборостроении. Уметь: представлять результаты анализа достижений в области микро - и нанотехнологий приборостроения в виде докладов. Владеть: навыками поиска и использования источников информации для анализа научно-технических проблем в области микро - и нанотехнологий.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
1	Основные процессы микро - и нанотехнологий	1	1-9		18			20		7/38	Рейтинг-контроль №1
2	Методы синтеза наноструктур и функциональных наноматериалов	1	10-15		12			22		5/42	Рейтинг-контроль №2
3	Перспективы развития нанотехнологий в приборостроении	1	16-18		6			30		3/50	Рейтинг-контроль №3
Всего		1	18		36			72		15/42	Зачёт с оценкой

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины

Введение.

Основные понятия. Микротехнология, Планарная полупроводниковая технология. Ограничения планарной технологии. Истоки, основные принципы и перспективы развития нанотехнологий.

Раздел 1. Основные процессы микро - и нанотехнологий.

Тема 1.1. Классификация процессов микро - и нанотехнологий

Общая классификация процессов микро - и нанотехнологий. Критерии классификации: характер протекания, способ активации, степень локализации. Процессы формирования новой фазы на поверхности подложки, удаление вещества с поверхности подложки, перераспределение атомов (ионов) примесей.

Тема 1.2. Процессы на поверхности и межфазной границе.

Атомная структура поверхностного слоя. Примесные атомы на поверхности. Свойства поверхности. Термодинамика поверхности: поверхностная энергия, поверхностное натяжение, капиллярные явления. Адсорбция, десорбция и испарение с поверхности.

Тема 1.3. Физические методы формирования новой фазы на поверхности подложки.

Классификация методов фазообразования. Газо -, жидко -, и твердофазные методы Гетерогенные процессы физической конденсации из газовой фазы. Вакуум – термическое испарение. Катодное распыление. Ионно - плазменное распыление. Магнетронное распыление. Импульсное лазерное осаждение тонких пленок.

Тема 1.4. Химические методы формирования новой фазы.

Химическое осаждение пленок из газовой фазы и растворов. Послойное химическое осаждение из газовой фазы. Электрохимические методы. Анодное окисление металлов и полупроводников. Электрохимическое и плазменное анодирование. Формирование моно- и мультислоев органических веществ.

Тема 1.5. Методы ориентированного выделения твердой фазы.

Механизмы зародышеобразования. Условия ориентированного фазообразования. Эпитаксия. Переходной эпитаксиальный слой. Автоэпитаксия. Гетероэпитаксия. Хемозэпитаксия. Газофазная эпитаксия. Быстрые термические процессы в технологии получения эпитаксиально-пленочных структур. Жидко- и твердофазная эпитаксия. Молекулярно - лучевая эпитаксия. Авто-, гетеро - и хемозэпитаксия.

Тема 1.6. Процессы перераспределения вещества.

Термодиффузионное легирование. Математическое описание диффузионных процессов в микроэлектронике. Ионное легирование полупроводников. радиационно - стимулированная диффузия. Низкоэнергетическая ионная имплантация методом погружения в плазму. Имплантография.

Тема 1.7. Процессы удаления вещества.

Процессы механического удаления вещества. Электроннолучевая обработка. Вакуум- термическое травление. Процессы химического травления: механизмы травления, методы и среды для жидкостного и газового травления; локальное и анизотропное ориентированное травление. Электрохимическое травление. Ионно - плазменное травление: методы и механизмы травления; ионно-лучевое, плазмохимическое, реактивное ионно-плазменное, ионно - химическое травление.

Тема 1.8. Методы литографии в микротехнологии.

Классификация базовых методов литографии: фото -, рентгено-, электроно- и ионолитография. Литографический цикл: резисты и способы их нанесения; позитивные и негативные; жидкие и сухие резисты; методы повышения адгезии, плазмостойкости; предэкспозиционная обработка; проявление и сушка. Фотошаблон. Способы совмещения и экспонирования.

Тема 1.9. Нанолитография.

Эволюция процессов экспонирования: высокоэффективные источники дальнего ультрафиолета, оптическая литография с фазовым сдвигом, внеосевая литография, стереолитография; электроно -, ионно -, рентгенография. Литография с использованием синхротронного излучения. Печатная нанолитография. Блок - сополимерная литография.

Раздел 2. Методы синтеза наноструктур и функциональных наноматериалов.

Тема 2.1. Классификация наноструктур.

Нульмерные наноструктуры: свободные кластеры, стабилизированные кластеры, кластеры в матрице, наночастицы в оболочке, самоорганизованные наноструктуры. Одномерные наноструктуры: нанонити, нанотрубки, нанопояса, наностержни. Двумерные наноструктуры: тонкие пленки, гетероструктуры, пленки Ленгмюра- Блоджетт, самособирающиеся слои, нанопластины. Трехмерные наноструктуры.

Тема 2.2. Методы исследования наноструктур.

Сканирующая зондовая микроскопия: туннельная, атомно - силовая, магнитно - силовая микроскопия. Электронная спектроскопия: рентгеновская фотоэлектронная, ультрафиолетовая электронная, электронная Оже - спектроскопия. Спектроскопические методы. Дифракционные методы исследования.

Тема 2.3 Методы формирования наноструктур.

Нанокластеры: структура, свойства, методы синтеза. Принципы формирования одномерных частиц. Углеродные нанотрубки: структура, свойства, механизмы роста, методы синтеза. Нанокompозиты на основе интеркалированных нанотрубок. Методы синтеза неорганических нанотрубок. Физические и химические методы формирования нанопленок и двумерных массивов нанобъектов.

Тема 2.4. Методы зондовой нанотехнологии.

Физические основы зондовой нанотехнологии. Контактное формирование нанорельефа. Бесконтактное формирование нанорельефа. Локальная модификация поверхности. Межэлектродный массоперенос. Электрохимический перенос. Массоперенос из газовой фазы. Локальное анодное окисление.

Тема 2.5. Методы получения наноматериалов.

Классификация методов синтеза наноматериалов. Методы формирования «снизу вверх»: испарение в электронной дуге, лазерное испарение, газофазный синтез, магнетронное распыление, синтез в нанореакторах, золь - гель метод, гидротермальный синтез. Методы формирования «сверху вниз»: механохимические методы, удаление компонента гетерогенной системы, метод кристаллизации стекла.

Тема 2.6. Процессы самоорганизации в наносистемах.

Движущие силы организации наносистем. Консервативная самоорганизация: самопроизвольное структурообразование в равновесных системах. Диссипативная самоорганизация; условия самоорганизации. Молекулярная самосборка. Типы межмолекулярного взаимодействия. Супраструктуры. Супрамолекулярные ансамбли.

Раздел 3. Перспективы развития нанотехнологий в приборостроении

Тема 3.1. Основные направления развития нанотехнологий в электронном приборостроении.

Технология создания быстродействующих нанотранзисторов: на углеродных нанотрубках, кремниевых нанопроводах, на основе графена. Технология приборов политроники: органических транзисторов, светоизлучающих светодиодов, нанопроводников. Полимерные наноструктуры для гибких экранов. Приборы квантовой электроники: лазеры и фотоприемники на структурах с квантовыми точками. Устройства на фотонных кристаллах. Нанoeлектронные запоминающие устройства. Технология конструкционных и технологических материалов с уникальными свойствами.

Тема 3.2. Технологические основы нано - и микроэлектромеханических систем.

Технологические аспекты разработки элементной базы нано - и микроэлектромеханики. Нанoeлементы для прямого преобразования электрической энергии в механическую. Сверхчувствительные наносенсоры. Нанoeлектромеханические приборы и системы. Нанoeлектромеханические запоминающие устройства. Микро - и нанооптоэлектромеханические системы. Микро-робототехника. Нано - и микроэлектромеханические датчики различных физических величин.

4.2. Практические занятия

Практические занятия (семинары), являясь формой индивидуально-группового обучения, имеют целью углубление и закрепление знаний, полученных в процессе самостоятельной работы, а также способствуют выявлению преподавателем уровня подготовки каждого студента и его возможностей.

Тематика практических занятий

1. Общая классификация процессов микро - и нанотехнологий.
2. Анализ физических методов получения тонких пленок.
3. Анализ химических методов получения тонких пленок.
4. Процессы введения и перераспределения примесных атомов в полупроводниковые кристаллы.
5. Физико-химические процессы удаления вещества.
6. Методы литографии в микротехнологии.
7. Базовые технологические процессы в производстве биполярных интегральных микросхем.
8. Базовые технологические процессы в производстве МДП микросхем.
9. Технологические аспекты разработки элементной базы микроэлектромеханических систем.
10. Анализ методов нанолитографии.
11. Методы зондовой нанотехнологии.
12. Методы получения наноматериалов.
13. Анализ процессов получения наносистем методом самоорганизации.
14. Технология создания быстродействующих нанотранзисторов.
15. Основные принципы и технологические проблемы молекулярной электроники

16. Конструкционные и технологические материалы с уникальными свойствами.
17. Технологические аспекты разработки элементной базы нанoeлектромеханических систем.
18. Нанoeлектромеханические датчики физических величин.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На практических занятиях используется проблемно-ориентированный подход, стимулирование активности путём привлечения к обсуждению проблем, возникающих в процессе выполнения заданий, применяются мультимедиа технологии (видеофильмы, презентации электронные альбомы и др.). Занятия проводятся в аудиториях 331-3, оборудованных техническими средствами для использования мультимедиа технологий (видеоматериалы, слайды) и 324-3, оборудованной компьютерной техникой и средствами для использования мультимедиа технологий. В процессе подготовки к занятиям студенты имеют возможность работать в Интернете, пользуясь ресурсами компьютерных классов кафедры (330-3,503-3).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

6.1 Текущий контроль успеваемости

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:

- а) оценка выполняемых на практических занятиях и домашних заданий;
- б) оценка активности участия в дискуссиях на практических занятиях;
- в) проведение рейтинг - контроля.
- г) экспресс-опрос на практических занятиях;
- д) индивидуальное собеседование, консультация;
- е) выступление с докладом, презентацией.

Вопросы к рейтинг - контролю

Рейтинг - контроль №1

1. Классификация физико-химических процессов микро- и нанотехнологий по характеру протекания.
2. Способы активации физико-химических процессов.
3. Атомная структура поверхностного слоя.
4. Термодинамические свойства поверхности.
5. Явления и процессы на межфазной границе.
6. Классификация физико-химических методов фазообразования.
7. Методы ионного распыления.
8. Импульсное лазерное осаждение тонких пленок.
9. Пиролитическое осаждение металлов.
10. Послойное химическое осаждение из газовой фазы.
11. Химическое осаждение пленок из растворов.
12. Электрохимическое осаждение слоев.
13. Плазмохимическое осаждение пленок.

Рейтинг - контроль №2

1. Условия ориентированного фазообразования на подложке.
2. Виды и методы эпитаксии.
3. Молекулярно-лучевая эпитаксия.
4. Сущность и виды эндотаксии.
5. Механизмы термодиффузионного легирования.
6. Механизмы ионного легирования полупроводников.
7. Вакуум-термическое травление.
8. Механизмы жидкостного и газового химического травления.

9. Механизмы анизотропного травления.
10. Электрохимическое травление.
11. Методы ионно-плазменного травления.
12. Сущность и базовые методы фотолитографии.
13. Ограничения оптической литографии.
14. Виды нанолитографии.

Рейтинг - контроль №3

1. Классификация наноструктур по размерности.
2. Методы сканирующей зондовой микроскопии.
3. Методы электронной микроскопии.
4. Спектроскопические методы исследования наноструктур.
5. Методы получения одномерных наноструктур.
6. Механизмы роста и способы получения углеродных нанотрубок.
7. Способы получения нанопленок.
8. Методы формирования наноструктур, проявляющих свойства фотонных кристаллов.
9. Физические основы и методы зондовой нанотехнологии.
10. Классификация методов синтеза функциональных материалов.
11. Физические методы синтеза наночастиц.
12. Химические методы синтеза наночастиц.
13. Процессы самосборки в наносистемах.

6.2 Зачёт с оценкой

Зачёт с оценкой проводится по билетам. Обучающийся должен продемонстрировать знание основ микро - и нанотехнологий, сущности и методов анализа процессов микро - и нанотехнологий, научных направлений развития нанотехнологий в приборостроении, умение анализировать перспективы развития нанотехнологий в области приборостроения.

Вопросы к зачёту с оценкой

1. Классификация физико-химических процессов микро - и нанотехнологий по характеру протекания.
2. Атомная структура поверхностного слоя.
3. Термодинамические свойства поверхности. Явления и процессы на межфазной границе.
4. Классификация физико-химических методов фазообразования.
5. Гетерогенные процессы физической конденсации из газовой фазы.
6. Методы ионного распыления.
7. Импульсное лазерное осаждение тонких пленок. Пиролитическое осаждение металлов.
8. Послойное химическое осаждение из газовой фазы.
9. Химическое осаждение пленок из растворов.
10. Электрохимическое осаждение слоев.
11. Плазмохимическое осаждение пленок.
12. Условия ориентированного фазообразования на подложке. Виды и методы эпитаксии. Сущность и виды эндотаксии.
13. Молекулярно-лучевая эпитаксия.
14. Механизмы термодиффузионного легирования.
15. Механизмы ионного легирования полупроводников.
16. Вакуум - термическое травление Механизмы жидкостного и газового химического травления.
17. Механизмы анизотропного травления.
18. Электрохимическое травление.
19. Методы ионно-плазменного травления.
20. Сущность и базовые методы фотолитографии. Ограничения оптической литографии.
21. Виды нанолитографии.
22. Классификация наноструктур по размерности.
23. Методы сканирующей зондовой микроскопии.
24. Методы электронной микроскопии.

25. Спектроскопические методы исследования наноструктур.
26. Методы получения одномерных наноструктур.
27. Механизмы роста и способы получения углеродных нанотрубок.
28. Способы получения нанопленок.
29. Физические основы и методы зондовой нанотехнологии.
30. Классификация методов синтеза функциональных материалов.
31. Физические методы синтеза наночастиц.
32. Химические методы синтеза наночастиц.
33. Процессы самосборки в наносистемах.
34. Технология создания быстродействующих нанотранзисторов
35. Технологические аспекты разработки элементной базы нано - и микроэлектромеханики
36. Наноэлементы для прямого преобразования электрической энергии в механическую энергию.
37. Сверхчувствительные наносенсоры.
38. Наноэлектромеханические запоминающие устройства.
39. Микро - и нанооптоэлектромеханические системы.
40. Наноэлектромеханические датчики физических величин.

6.3 Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов включает изучение теоретического материала, выполнение заданий по тематике практических занятий, подготовку реферата, презентации, подготовку к рейтинг - контролю. Основа самостоятельной работы – изучение рекомендуемой литературы, электронных источников. Текущий контроль освоения материала проводится в процессе проведения практических занятий и консультаций, проведения рейтинг - контроля, индивидуальных собеседований.

Вопросы для проведения контроля самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины.

Раздел 1.

1. Критерии классификации процессов формирования новой фазы на поверхности подложки.
2. Процессы на поверхности и межфазной границе.
3. Термодинамика поверхности.
4. Вакуумно-термическое испарение. Катодное распыление.
5. Ионно - плазменное распыление.
6. Магнетронное распыление.
7. Импульсное лазерное осаждение тонких пленок.
8. Химическое осаждение пленок из газовой фазы.
9. Химическое осаждение пленок из растворов.
10. Электрохимические методы осаждения пленок.
11. Механизмы и условия ориентированного фазообразования.
12. Формирование моно - и мультислоев органических веществ.
13. Процессы введения и перераспределения вещества.
14. Процессы механического удаления вещества.
15. Процессы химического травления.
16. Процессы электрохимического удаления вещества.
17. Базовые методы литографии в технологии электроники.
18. Методы нанолитографии.

Раздел 2

1. Нульмерные наноструктуры.
2. Одномерные наноструктуры.
3. Двумерные наноструктуры.
4. Трехмерные наноструктуры.

5. Сканирующая зондовая микроскопия.
6. Спектроскопические методы исследования наноструктур.
7. Принципы формирования одномерных частиц.
8. Методы формирования нанопленок.
9. Методы двумерных массивов нанообъектов.
10. Методы зондовой нанотехнологии.
11. Методы формирования наноматериалов «снизу вверх».
12. Методы формирования наноматериалов «сверху вниз».
13. Процессы самоорганизации в наносистемах.

Раздел 3

1. Технология создания быстродействующих нанотранзисторов на углеродных нанотрубках.
2. Технология создания быстродействующих нанотранзисторов на кремниевых нанопроводах.
3. Технология создания быстродействующих нанотранзисторов на основе графена.
4. Технология органических транзисторов.
5. Технология органических светодиодов,
6. Технология нанопроводников.
7. Полимерные наноструктуры для гибких экранов.
8. Тазеры и фотоприемники на структурах с квантовыми точками.
9. Устройства на фотонных кристаллах.
10. Нанозлектронные запоминающие устройства.
11. Технология конструкционных и технологических материалов с уникальными свойствами.
12. Технология приборов политроники.
13. Технологические основы молекулярной электроники.

Формы отчета студента перед преподавателем о результатах выполнения самостоятельной работы: конспекты, планы, реферат, обзоры информации, графическое представление изученного учебного материала, презентации. Виды контроля самостоятельной работы студентов: экспресс-опрос на практических занятиях; текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; индивидуальное собеседование, консультация, выступление с докладом.

Темы рефератов

1. Технология создания быстродействующих нанотранзисторов
2. Технология приборов политроники.
3. Приборы квантовой нанозлектроники
4. Устройства на фотонных кристаллах.
5. Технология функциональных наноматериалов.
6. Технология сверхчувствительных наносенсоров.
7. Технологические основы нанозлектромеханических запоминающих устройств.
8. Технологические основы нанооптоэлектромеханических систем.
9. Технологические основы микроэлектромеханических датчиков физических величин.
10. Технологические основы нанозлектромеханических датчиков физических величин.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература

1. Мелихов, И.В. Физико-химическая эволюция твердого вещества [Электронный ресурс] / И. В. Мелихов. -3-е изд. (эл.) - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 312 с.). -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - (Нанотехнологии). - ISBN 978-5-9963-2532-0.

Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325320.html>.

2. Патрушева, Т.Н. Сенсорика. Современные технологии микро - и нанозлектроники: Учебное пособие / Т.Н. Патрушева - М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: Сибирский федер. ун-т, 2014.

- 260 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006376-8, 500 экз.
Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374604>.

3. Старостин, В.В./ Материалы и методы нанотехнологий: учебное пособие. - 3-е изд. (эл.) (Нанотехнологии) Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний 2012. -438с - ISBN: 978-5-9963-1444-7. Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326013.html>.

5. Нанотехнологии в электронике. Выпуск 2 [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.А. Чаплыгина - М.: Техносфера, 2013. - 688с., ISBN9785948363530.

Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785948363530.html>.

б) дополнительная литература

6. Акуленок, М. В. Введение в процессы интегральных микро - и нанотехнологий : учебное пособие для вузов: в 2 т./ Т. 2 : Акуленок М. В., Андреев В. М. и др. Технологические аспекты. М., БИНОМ, 2011. Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996303366.html>.

7. Раскин, А.А. Технология материалов микро -, опто - и наноэлектроники : учебное пособие для вузов по направлению 210100 "Электроника и микроэлектроника" : [в ч.] / А. А. Раскин, В. К. Прокофьева.— Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2010.— ISBN 978-5-94774-913-7. (Библиотека ВлГУ)

8. Бычков, С.П.. Физические основы микро - и нанотехнологий [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / С.П. Бычков, В.П. Михайлов, Ю.В. Панфилов, Ю.Б. Цветков; Под ред. Ю.Б. Цветкова. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009.

Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703833193.html>.

9. Неволин, В.К Зондовые нанотехнологии в электронике. Издание 2-е, исправленное Москва: Техносфера, 2014. - 176с. - ISBN 978-5-94836-382-0.

Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785948363820.html>.

в) периодические издания

10. Микроэлектроника (Библиотека ВлГУ)

11. НАНО: технологии, экология, производство (Библиотека ВлГУ)

12. Наноматериалы и наноструктуры XXI век (Библиотека ВлГУ)

13. Наносистемы: физика, химия, математика (Библиотека ВлГУ)

14. Нанотехнологии: разработка, применение - XXI век (Библиотека ВлГУ)

15. Нанотехнологии: Наука и производство (Библиотека ВлГУ)

в) интернет - ресурсы

16. <http://znanium.com/>

17. <http://e.lanbook.com/>

18. <http://elibrary.ru/>

19. www.studentlibrary.ru/

20. www.iprbookshop.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в аудитории 324-3, оборудованной техническими средствами для использования мультимедиа технологий (видеоматериалы, слайды); в аудитории 323-3, оборудованной компьютерной техникой. В процессе подготовки к занятиям студенты имеют возможность работать в Интернете, пользуясь ресурсами компьютерных классов кафедры (а.222-3, 330-3).

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 12.04.01 "Приборостроение"

Рабочую программу составил доцент Фролова Т.Н. Фролова

Рецензент

зам. главного инженера по подготовке
производства – главный технолог ОАО

"Владимирский завод Электроприбор" Зайцев М.К. Зайцев

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры БЭСТ _____

Протокол № 9 от 30.05. 2016 года

Заведующий кафедрой Сушкова Л.Т. Сушкова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 12.04.01 "Приборостроение"

Протокол № 9 от 30.05. 2016 года

Председатель комиссии Сушкова Л. Т. Сушкова

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

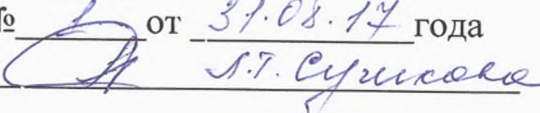
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

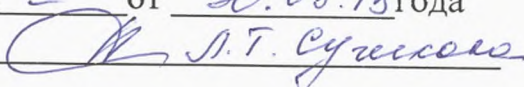
Заведующий кафедрой _____

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 12.06.01 «ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ,
ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»**

Направленность подготовки:

Приборы и методы измерения

Рабочая программа одобрена на 2017/2018 учебный год
Протокол заседания кафедры № 1 от 31.08.17 года
Заведующий кафедрой  С.Т. Сущикова

Рабочая программа одобрена на 2018/2019 учебный год
Протокол заседания кафедры № 1 от 30.08.18 года
Заведующий кафедрой  С.Т. Сущикова

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____